

RIBER

RIBER社MBEセル(蒸着源)

RIBER社では、材料特性や用途に合わせて豊富なMBEセルをラインナップしています。RIBER社オリジナル装置含め、ありとあらゆるMBE装置の仕様に合わせてカスタマイズ提案が可能です。

主な製品ラインナップ

- 標準型クヌーセンセル
- バルブドクラッカーセル
(ヒ素、リン、アンチモン向け)
- 大容量・高安定性III族セル
- 窒化物向け高耐性エフュージョンセル
- 特殊用途セル
(高温セル、昇華型カーボンセル)
- 窒素、酸素RFプラズマ源
- 高温・低温ガスインジェクター



Hakuto

イオンビームミリング装置

イオンビームミリング装置は、基板サイズ/材質、加工材料を問わずにご使用いただける、研究開発用に最も適したエッチング装置です。特に、磁性材料、金属多層膜、各種合金などの難エッチング材料の加工の実績が多数ございます。

特徴

- スピントロニクス分野での実績多数
- 国産イオンソース搭載機を新価格でご提案
- 真空コンポーネントはPfeiffer Vacuum社製
(弊社総代理店)を標準装備
- 廉価版など、ご予算に応じた機器構成をご提案
- GUIによる直観的なプロセス操作
- 国内デモ随時承ります。



弊社は約半世紀にわたり、MBE装置、イオンビーム製品を取り扱っております。豊富な実績と経験により、お客様の研究開発に貢献致します。

お問い合わせ先

伯東株式会社

システムプロダクツカンパニー

〒160-8910 東京都新宿区新宿一丁目1番13号

TEL: 03-3355-7645 Email: F1@hakuto.co.jp

関西支店 TEL: 06-6350-8913